## **C07** 化学溶液法による Al-doped Zn0/BiFeO<sub>3</sub>/(Li, Sr) MnO<sub>3</sub> 積層薄膜の作製 と光誘起特性

## (名大未来材料・システム研) 〇土森祥平・林 幸壱朗, 坂本 渉, 余語 利信

E-mail: tsuchimori.shohei@h.mbox.nagoya-u.ac.jp

【諸言】

BiFe0<sub>3</sub>(BF0)は、室温域で強誘電性と(反)強磁性を同時に示す非常に稀な物質であり、その特性を利用した新規デバイスへの応用が期待されている。また、BF0系化合物は強誘電体の中でもバンドギャップが狭く、 紫外光だけでなく、可視光領域の光照射によっても光電流および光起電力が発生することから注目が集まっている<sup>1)</sup>。しかし、BF0系薄膜は一般に光電流値が微弱であるという問題点もあり、その改善が課題となっている。本研究ではAl-doped Zn0(AZ0)をn型半導体、Sr-doped LaMnO<sub>3</sub>(LSM0)をp型半導体とみなし、BF0(p型半導体)薄膜を積層した p-BF0-n 構造の薄膜を作製することによる光誘起特性の向上を試みた。

## 【実験方法】

積層構造薄膜を作製するにあたり、基板には Pt/TiO<sub>x</sub>/SiO<sub>2</sub>/Si 基板を用いた。Sr, La および Mn の酢酸塩を 出発原料とし、溶媒として水および 2-メトキシエタノールを用いることで (La<sub>0.7</sub>Sr<sub>0.3</sub>) MnO<sub>3</sub> (LSMO) 前駆体溶液 を調製した。この溶液を基板上にスピンコートし、乾燥、か焼、結晶化処理を行うことで LSMO 薄膜を作製し た。結晶化処理は O<sub>2</sub>雰囲気下で 700 °C, 30 min の条件で行った。BFO 薄膜は、Bi および Fe の金属アルコキ シドを出発原料とし、溶媒として 2-メトキシエタノールを用いることで BFO 前駆体溶液 (Bi は 5 mol%過剰 組成)を調製し、LSMO 薄膜と同様の手順で作製した。なお、結晶化処理は O<sub>2</sub>雰囲気下で 600 °C, 30 min の

条件で行った。また、AZO 薄膜は、硝酸アルミニウムおよび酢酸亜鉛を出発原料とし、溶媒として 2-メトキシエタノール、溶液への添加剤としてモノエタノールアミンを用いることで AZO 前駆体溶液を調製し、LSMO 薄膜と同様の手順で作製した。結晶化処理は 0<sub>2</sub> 雰囲気下で 550°C, 1 h の条件で行った。

【結果と考察】

XRD 測定結果より、LSMO 単独膜はペロブスカイト単相であることを確認した。 LSMO 単独膜の AFM 表面像を Fig. 1 に示す。RMS 表面粗さは約4 nm であり、AFM 像からも表面平滑性が高いことがわかった。また、LSMO 膜部分の抵抗率の 値は 0.2 Ω・cm であった。さらに、AZO/BFO/LSMO 積層構造膜の XRD 測定結 果を Fig. 2 に示す。ペロブスカイト BFO, LSMO 相および ZnO 相由来のピ ークを確認した。次に、光源に白色光(400-700 nm, 90 klx)を用い、光照 射 on-off 状態での薄膜中に流れる電流値(ゼロ電界下)を測定すること で、積層構造薄膜の光電流測定を行った。BFO 単独膜と比較すると積層構 造膜では約400 倍に光電流が増大した。これは p-BFO-n 構造の形成により 積層膜中の内部バイアスが増大したことに加え、電流を取り出す電極へよ り円滑な電荷の移動が行われたためだと考えられる。



Fig. 1 AFM surface image of



layered thin film